



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201534156 U

(45) 授权公告日 2010. 07. 28

(21) 申请号 200920204737. X

(22) 申请日 2009. 09. 11

(73) 专利权人 常州捷佳创精密机械有限公司

地址 213100 江苏省常州市新北区机电工业
园宝塔山路 9 号

(72) 发明人 左国军

(74) 专利代理机构 深圳市康弘知识产权代理有
限公司 44247

代理人 胡朝阳 孙洁敏

(51) Int. Cl.

B08B 3/10 (2006. 01)

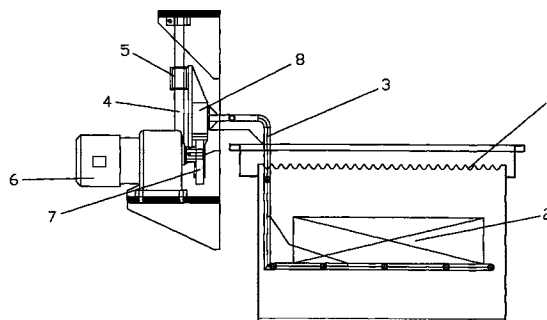
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种工件清洗设备的抛动装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种工件清洗设备的抛动装置,包括置于槽体内并与清洗篮连接的托架,其中:所述托架与槽体外一抛动机构连接,该抛动机构包括有导杆、可沿该导杆上下移动的滑块、固定的马达,马达的转轴上设置有一凸轮,滑块与托架之间通过一抛动横梁连接,凸轮与该抛动横梁相接适配。采用抛动机构带动清洗篮上下抛动,水流在工件表面充分流动、冲刷,使工件得到了清洗充分,工件表面附着有脱胶剂和其它杂质很容易被清洗掉,达到很好的清洗效果。



1. 一种工件清洗设备的抛动装置,包括置于槽体(1)内并与清洗篮(2)连接的托架(3),其特征在于:所述托架(3)与槽体(1)外一抛动机构连接,该抛动机构包括有导杆(4)、可沿该导杆上下移动的滑块(5)、固定的马达(6),该滑块与所述托架(3)连接,所述马达(6)的转轴上设置有一凸轮(7),该凸轮与所述托架(3)相接适配。

2. 根据权利要求1所述的工件清洗设备的抛动装置,其特征在于:所述滑块(5)与托架(3)之间通过一抛动横梁(8)连接,所述凸轮(7)与该抛动横梁(8)相接适配。

一种工件清洗设备的抛动装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到工件清洗设备,尤其涉及一种工件清洗设备的抛动装置。

背景技术

[0002] 现有工件的清洗都是在脱胶流程后再进行工件的清洗处理,工件(如硅片)经脱胶流程后,表面附着有脱胶剂和其它杂质,目前的工件清洗设备,不能使水流在工件表面充分流动和冲刷,因而都很难使工件(如硅片)得到充分的清洗,达不到很好的清洗效果,从而产生很多不合格的产品。因此,如何使工件清洗设备彻底地将脱胶剂和其它杂质清洗掉是业内亟待解决的一个技术问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决上述的技术问题,提供一种能使水流在工件表面充分流动和冲刷的工件清洗设备抛动装置。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型提供的技术方案是:一种工件清洗设备的抛动装置,包括置于槽体内并与清洗篮连接的托架,其中:所述托架与槽体外一抛动机构连接,该抛动机构包括有导杆、可沿该导杆上下移动的滑块、固定的马达,该滑块与所述托架连接,所述马达的转轴上设置有一凸轮,该凸轮与所述托架相接适配。

[0005] 较佳技术方案:包括上述技术方案,所述滑块与托架之间通过一抛动横梁连接,所述凸轮与该抛动横梁相接适配。

[0006] 与现有技术相比,本实用新型中,与清洗篮连接的托架与清洗槽体外的抛动机构连接,采用抛动机构带动清洗篮上下抛动,水流在工件表面充分流动、冲刷,使工件得到了清洗充分。工件表面附着有脱胶剂和其它杂质很容易被清洗掉,达到很好的清洗效果。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型作出详细的说明,其中:

[0008] 图1是本实用新型较佳实例的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 本实用新型较佳实例,如图1所示的一种工件清洗设备的抛动装置,包括置于槽体1内并与清洗篮2连接的托架3,槽体1外设置有一抛动机构,该抛动机构包括有导杆4、套在导杆上并可沿该导杆上下移动的滑块5、与设备固定的马达6,滑块5与托架3连接,马达6的转轴上设置有一凸轮7,凸轮与托架3相接适配,凸轮转动时会驱动托架3上下移动。为更好地配合抛动机构,在滑块5与托架3之间通过一抛动横梁8连接起来,凸轮7再与该抛动横梁8相接适配,抛动横梁与凸轮接触能更协调,凸轮转动时会驱动抛动横梁8上下移动,从而带动托架3上下抛动。

[0010] 把清洗篮2放置于与抛动横梁连接的抛动托架3上,马达转动,带动安装于其输出

转轴上的凸轮转动, 凸轮的转动使抛动横梁上下抛动, 清洗篮也上下抛动, 水流在工件表面充分流动、冲刷, 使工件得到了清洗充分, 工件表面附着有脱胶剂和其它杂质很容易被清洗掉, 从而达到清洗要求。

[0011] 以上结合较佳实施方式对本实用新型进行了具体描述, 但是本技术领域内的技术人员可以对这些实施方式做出多种变更或变化, 这些变更和变化应落入本实用新型保护的范围之内。

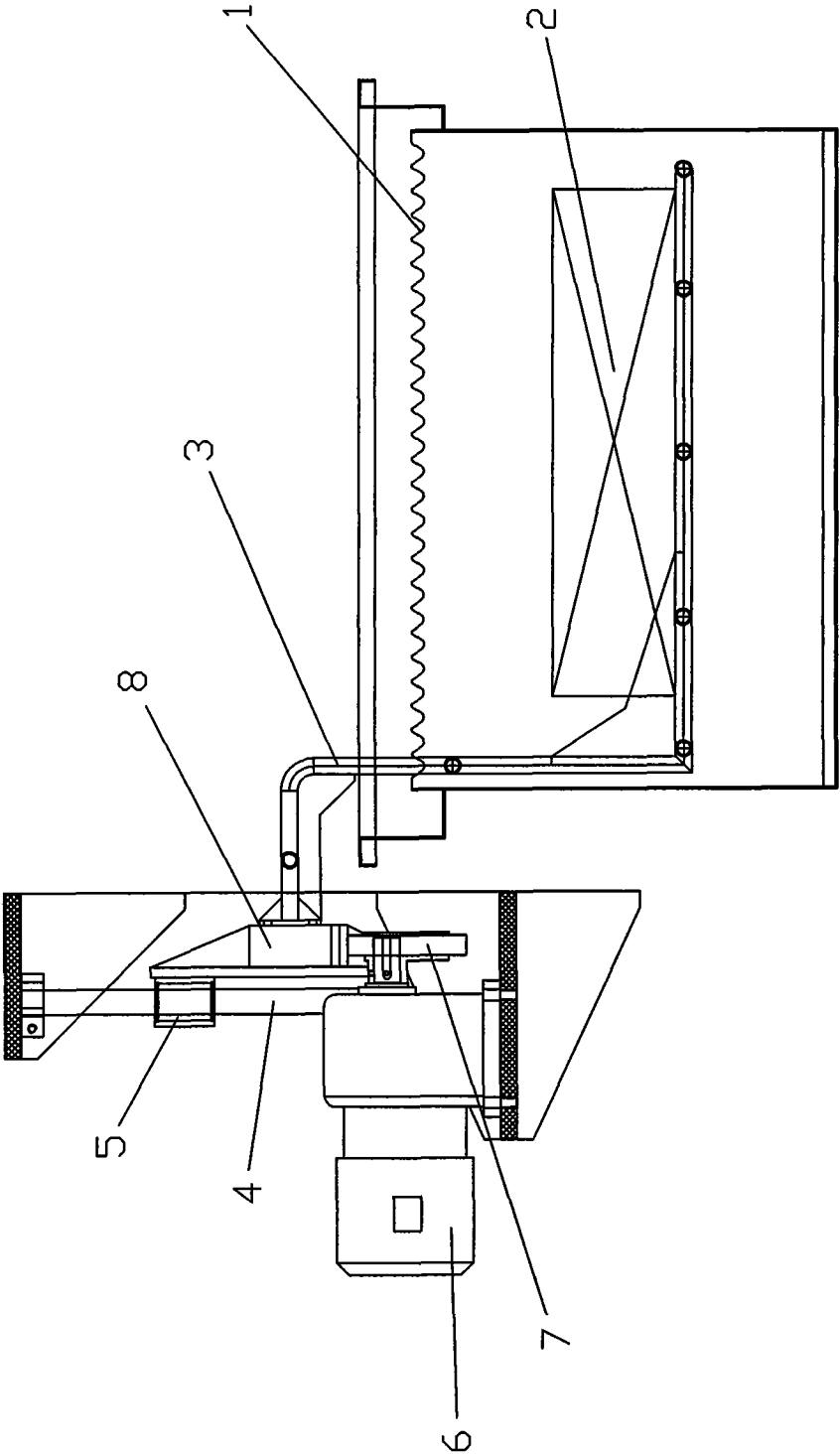


图 1